

OES/EPD/PEM System

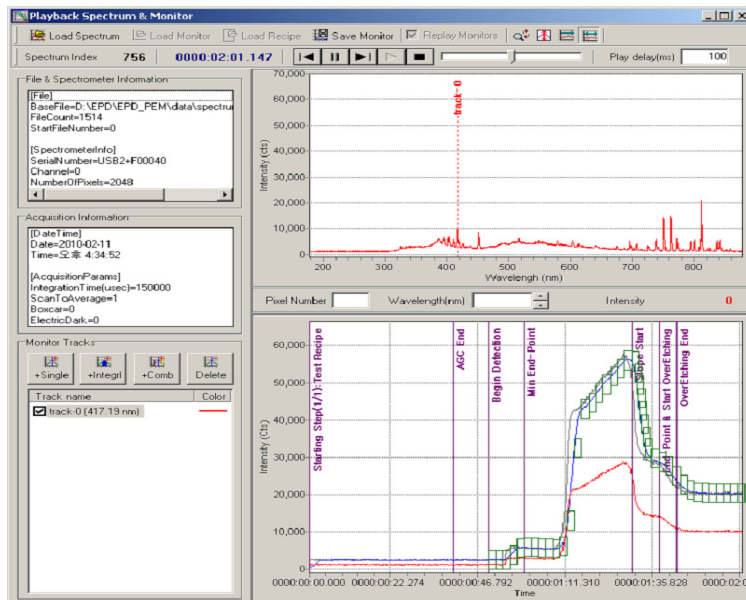
WEP Series



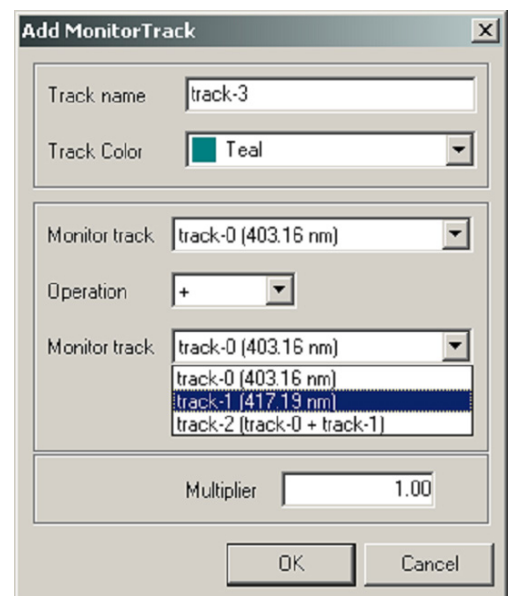
WEP Series는 Plasma를 이용한 반도체, LCD, LED 등의 생산 공정에서 플라즈마 가스의 분광을 실시간으로 모니터링 및 분석하여 식각 및 증착 등의 종료점(End-point)을 검출하는 EPD (End-Point Detection) 기능과 플라즈마 성분을 비례 제어하거나 플라즈마 이상방전을 감지할 수 있는 PEM(Plasma Emission Monitoring) 기능을 제공합니다.

- 물질의 분광 특성 (파장범위, 분광광도, 픽셀분해)에 따라 적합한 분광기 선택 가능
- 하나의 시스템 당 최대 8개의 분석 채널 확장 가능
- 모니터링 PC와 통신을 위한 USB 2.0 인터페이스
- Ethernet Network를 통한 원거리 원격조종
- 주변 제어기와 디지털 및 아날로그 통신 입출력 기능
- 시스템에 포함된 EP소프트웨어 EPD파라미터 데이터를 이용한 최적의 검출 조건

WEP Software



- 전파장 스펙트럼 표시 (OES)
- 모니터링 대상 파장의 선택 및 조합



- Recipe 지원
- Spectrum Reprocessing 기능
(기존에 수집된 스펙트럼 데이터의 재분석)